科学研究費助成事業

研究成果報告書 6 月 平成 28 年 9 日現在

機関省方: 32641
研究種目: 若手研究(B)
研究期間: 2014~2015
課題番号: 2 6 8 7 0 5 9 5
研究課題名(和文)プラズマへ導入された大気粉塵のイオン化率の改善
研究課題名(央文)Acceleration of vaporization, atomization, and ionization efficiencies in inductively coupled plasma by merging laser-ablated particles with hydrochloric acid gas
研究代表者
中澤 隆 (Nakazawa, Takashi)
中央大学・理工学部・助教
研究者番号:1 0 7 0 9 6 8 7
交付決定額(研究期間全体):(直接経費) 3,000,000円

研究成果の概要(和文):プラズマ内でのアブレート粒子のイオン化までの過程を改善させるために、粒子導入経路の 途中で塩化水素ガスを混合し、アブレート粒子と共にプラズマへ導入した。200 に設定した赤外加熱管中で2mol/L塩 化水素ガスとアブレート粒子を混合させると、超純水をアブレート粒子と混合した場合と比較して元素によらず全体的 に平均32%のアブレート粒子濃度の増加が得られた。塩酸によるアブレート粒子表面の腐食及び酸化物から塩化物へ の形態変化が観察された。本研究では、アブレート粒子への塩化水素ガス混合によって、アブレート粒子の気化、原子 化、イオン化過程が促進されることを見出した。

研究成果の概要(英文):To accelerate vaporization, atomization, and ionization efficiencies in laser ablation inductively coupled plasma mass spectrometry, we merged HCI gas with laser-ablated particles before introduction into the plasma, to convert their surface constituents from oxides to lower-melting chlorides. When particles were merged with HCl gas generated from HCl solution at 200 , the measured concentrations of elements in the particles were 132% higher on average than the concentrations in particles merged with ultrapure water. Particle corrosion and oxide conversion to chlorides were confirmed by scanning electron microscopy and X-ray photoelectron spectroscopy, respectively. This experimental results suggests that vaporization, atomization, and ionization of the ablated particles in the ICP improved when HCI gas was merged with the ablated particles.

研究分野: 分析化学

キーワード: レーザーアブレーション 誘導結合プラズマ質量分析 赤外加熱管 酸化物粒子 塩化物粒子 融点 沸点

1. 研究開始当初の背景

大気粉塵を誘導結合プラズマ質量分析計 (ICP-MS) へ直接導入し、大気粉塵に含ま れる元素をリアルタイムでモニタリングで きるようになってきた。しかし、ICP-MS へ 導入された大気粉塵濃度を、ニトロセルロー スフィルター上に捕集された大気粉塵濃度 で割ることで、回収率を求めたところ、酸化 物の融点及び沸点の高い元素において低い 回収率が得られた。こでは、ICP-MS へ直接 導入された大気粉塵の気化・原子化・イオン 化までの過程が不完全であったため、フィル ター捕集された大気粉塵濃度よりも ICP-MS へ直接導入された大気粉塵濃度が低くなっ たと考えられる。それゆえ、プラズマ内へ直 接導入された大気粉塵のイオン化率の向上 を図る必要がある。

2. 研究の目的

ICP-MSの大気試料導入系の開発を行うこ とを目的とした。大気粉塵中の元素の多くは 酸化物として存在していると考えられる。一 方、酸化物と塩化物の融点を比較すると、塩 化物の方が低い融点を持つ。よって、プラズ マへ導入される大気粉塵の化学状態を酸化 物から塩化物に換えることができれば、プラ ズマ内での大気粉塵の気化・原子化・イオン 化の過程が促進され、イオン化率の向上が見 込まれる。

研究の方法

(1)装置

試料は空気雰囲気下で波長 213 nm の Nd: YAG レーザー (UP213, ESI) を用いてアブレ ートした。ブランクにはクリーンベンチ (class 100)の空気を用いた。LA 部において 発生したアブレート粒子はインパクターに 1.0 L min⁻¹ で通し、粒径 1.0 μm以下のアブ レート粒子にカットした。インパクターの出 口で経路を分岐させ、サンプルの一部を、ミ ニポンプを用いて流量 0.25 L min⁻¹ で Gas Exchange Device (GED; J-Science Lab Co.) に導入し、空気を Ar に置換した。残りのサ ンプルはマスフローコントローラーを接続 したダイヤフラムポンプを用いて流量0.75L min^{-1} で孔径 0.025 μm のニトロセルロース フィルタ上に 1 時間捕集した。GED を通過 したサンプルは 赤外加熱管に導入し HC1 ガ スと混合した。HC1 ガスはマントルヒーター を用いて塩酸溶液を気化させることで赤外 加熱管に導入した。赤外加熱管を通過した試 料はICP-MS (7500ce, Agilent Technologies) に直接導入した。定量を行う際は、検量線溶 液を脱溶媒装置と連結させた超音波ネブラ イザー (U6000AT+, CETAC) から ICP-MS へ導 入した。使用した超音波ネブライザーの導入 効率は元素に依存せず一定である1)。

(2) 測定試料

サンプルとして、多くの元素が酸化物とし

て加えられている NIST 610 ガラス標準物質 (National Institute of Standards and Technologies, Gaithersburg, MD) を用いた。 アブレートされたガラス粒子の化学形態を 変化させるために、塩化水素ガスを用いた。 塩化水素ガスは、希釈した塩酸(30%高純度 試薬, Tama chemicals. Co., Japan) を 120℃ のマントルヒーター内に設置させたフラス コにネブライザー (AR30-07-PFA2, ESI, Oregon, USA) を使って 2 mL min⁻¹で導入し た。そして、発生した塩化水素ガスを赤外加 熱管に導入した。検量線溶液には多元素混合 標準溶液を用いた。内標準には Rh 標準溶液 を用いた。また、ネブライザーの導入効率を 算出するために Cr(CO)₆ 標準ガスを Metal Standard Gas Generator から導入した。USN の導入効率は実験を行うごとに求めた。導入 効率は 2~3%であった。酸分解では HNO₃, HF, H₂O₂を用いた。すべての溶液の調製、希釈に は超純水を用いた。

(3) 測定

本実験では塩酸の濃度及び赤外加熱管の 温度に依存した定量値の変化を求めた。まず、 マントルヒーターから超純水を導入した場 合と、2 M,4 M 及び 6 M の塩酸を導入した 場合でアブレート粒子の定量値の比較を行 った。この際、赤外加熱管の温度は 200℃に 設定した。また、マントルヒーターから導入 する溶液を 2M HC1 に固定し、赤外加熱管の 温度を 200℃、300℃及び 400℃に変化させた 場合におけるアブレート粒子の分析値の比 較を行った。

アブレート粒子の ICP への導入と同時にフ ィルタ上で捕集されたアブレート粒子はHF 3 mL, HNO₃ 6 mL, H₂O₂ 1 mL を加え、マイクロ 波分解装置(Ethos One, Milestone, Italy) を用いて分解を行った。その後、230°Cに設 定したホットプレート上で試料を 70 分間加 熱し、HF の除去を行った。最終的に超純水で 試料が 10 mL になるように定容した後に、 ICP-MS で測定を行った。

粒子に水を混合させた場合と塩酸を混合 させた粒子の表面形状を比較するために、 SEM観察を行った。NIST 610 をアブレートし、 超純水もしくは 2M 塩酸とアブレート粒子を 400℃の赤外加熱管で混合させた試料それぞ れを 40 分間、孔径 0.025 μ mのフィルタに 捕集した。粒子表面を SEM (S-4300, Hitachi High Technologies)を用いて観察を行った。 フィルタの表面は Pt/Pd 合金の蒸着を施し た。

粒子に塩酸を混合した際の組成の変化を 確認するため、粒子表面を XPS (Axis-HSi 165, Kratos/Shimadzu Corp.)を用いて分析 した。超純水もしくは 2M 塩酸を 400℃の赤 外加熱管で混合させ、孔径 0.025 μ mフィル タ上にアブレート粒子を 2 時間捕集し、そ の後測定に供した。Si と C1 の結合状態が確 認できるスペクトルを得るために、Si 2p に ついて測定を行った。ピーク分離には Igor (市販ソフトウェア)を用いた。

(4)回収率の算出

リアルタイムで直接測定した試料の測定 値をフィルタ捕集後に酸分解したサンプル の測定値で割り、パーセンテージで表した数 値を回収率とした。回収率は以下の式①を用 いて計算した

回収率 (%) = (Cd / Cf)×100 ①

Cdはアブレート粒子を直接 ICPMS で測定する ことによって得られた定量値 (ng L⁻¹)、Cf は アブレート粒子をフィルタ捕集し、その後酸 分解を施した後に得られた定量値 (ng L⁻¹)で ある。リアルタイム測定ではアブレート粒子 が直接測定される。一方フィルタ測定では酸 分解によってアブレート粒子がすべて液体 に分解されている。酸分解試料は ICP 中で完 全にイオン化しているとすると、式(1)は、 ICP-MS に直接導入されたアブレート粒子の プラズマ内でのイオン化の度合いを示す。

4. 研究成果

(1) 塩酸濃度に依存した増加率の変化

200℃の赤外加熱管に、超純水、2M, 4M 及 び 6M 塩酸溶液を気化して導入し、アブレー トされた粒子と混合した際に得られた増加 率を算出した。増加率は、超純水、2 M, 4 M, 6 M 塩酸溶液を赤外加熱管に導入し、その際 に得られたアブレート粒子のそれぞれの定 量値を超純水導入時の定量値で割ることで 求めた。超純水を混合した場合と 2 M 塩酸 を混合させた場合を比較すると、2 M 塩酸の 増加率がすべての元素で高くなった。全測定 元素の増加率の平均は 132 %である。4M 塩酸、 6M 塩酸と濃度を濃くすると増加率は 114%, 104%となった。塩酸の濃度を2M 塩酸よりも 濃くすると増加率が抑えられる理由につい てはロードエフェクト 3) が原因であると考 えられる。大量のHC1 ガスがプラズマに導入 されることによって、HC1 ガスのイオン化に プラズマ中のエネルギーが消費され、目的元 素のイオン化までの過程が不完全になった と考えられる。2 M 塩酸を加えた際、測定し たすべての元素について一様に増加率が上 昇したことから、塩酸によるアブレート粒子 へ元素依存性は少ないと考えられる。最も高 い増加率が得られたことから赤外過熱管へ 導入する HC1 の最適濃度条件は 2M に決定 した。

(2)赤外加熱管の温度に依存した増加率の 変化

増加率は、赤外加熱管に導入する塩酸濃度 を 2M に固定し、赤外加熱管の温度を 200℃, 300℃,400℃と変化させた時に得られた各測 定元素の定量値を赤外加熱管の温度 200℃の 定量値で割ることで求めた。酸化物の融点の 高い、59Co,90Zr,232Th について高い感度 が得られるように温度を変える毎にサンプ

リングデプスに関してチューニングを行っ た。最適サンプリングデプスは200℃では9.4 mm、300℃では 9.1 mm、400℃では 8.9 mm で あった。赤外加熱管の温度を上げるとサンプ リングデプスの最適値が小さくなる理由は、 プラズマ内でのイオンの拡散が生じたため と考えられる 4)。赤外加熱管の温度を 200℃、 300℃、 400℃と変え、導入する塩酸の濃度 を 2M に固定した時の測定元素の増加率を算 出した。Pb を除くすべての測定元素が赤外加 熱管の温度が高くなるほど、増加率が上昇す る傾向を示した。全元素で平均して、300℃ で 115 %、400℃で 135 %の増加率の上昇傾向 が見られた。この結果から、赤外加熱管内に おいて、アブレート粒子と HC1 ガスに加えら れる熱量が増加することで、アブレート粒子 中の酸化物の一部が塩化物に置き換わる反 応及び腐食による形状の変化が促進された と考えられる。よって、赤外加熱管の最適温 度条件は400℃に決定した。

(3) SEM 像の観察

400℃に設定した赤外加熱管にアブレート 粒子とともに超純水もしくは 2M HC1 ガスを 導入した際に得られたアブレート粒子表面 の SEM 像の観察結果を Fig. 1a, 1b に示す。 超純水を混合させたアブレート粒子の表面 は滑らかであった(Fig. 1a)。2M HC1 ガスを 混合させたアブレート粒子の表面は凸凹と した形状になっている (Fig. 1b)。このこと から、2M HC1 ガスをアブレート粒子と混合 させると、アブレート粒子の表面が酸により 腐食する。その結果、表面が荒くなり、アブ レート粒子の表面積が増加した。HC1 ガスと アブレート粒子を混合させる事によって、プ ラズマ内でエネルギーを受け取るアブレー ト粒子の表面積が増加し、アブレート粒子の プラズマ内での気化、原子化、イオン化が促 進されたと考えられる。また、腐食により粒 子の表面が壊れやすくなり、表面特性として 脆弱性が増加したこともイオン化までの過 程を促進する1つの要因と考えることができ る。2M 塩酸導入時の元素に依存しない増加 率の上昇はこの腐食が1つの原因である。



Fig. 1 超純水混合時のアブレート粒子(a) および塩酸混合時のアブレート粒子(b)

(4) XPS の結果

Fig. 2a に 400℃の赤外加熱管において水 蒸気とアブレート粒子を混合した際に、フィ ルター上に得られた粒子の Si 2p の XPS 測定 結果を示す。Fig. 2a 中に黒線で示された XPS スペクトルのフィッティングカーブをピー ク分離すると、1 つのピークのみ得られた



Fig. 2 (a) 水蒸気と混合したアブレート粒 子の XPS スペクトル (b) 塩酸ガスと混合した アブレート粒子の XPS スペクトル

ピークトップは 102.7 eV である。Si02 の ピークはデータベース 5)によると、103.1~ 103.4 eV に観測されるが、検出されたピーク は低いエネルギー側で観測された。Si02 と Na20 が混合したガラスを XPS で測定した場合 の Si02 のピークは、低エネルギー側にシフ トする。また、Si02 69%と Na20 30 %の混合 物の場合は 0.8 eV ほど Si02 結晶と比較して 低エネルギー側にピークが観測されると報 告されている 5)。従って、Fig. 2a の青線の ピークは、Si02, Na20 混合物の Si02 の XPS ピークと良い一致を示している。よって、 102.7 eV 付近の青線で示したピークは、Si02 由来のものであると帰属した。

Fig. 2b に 400℃の赤外加熱管において 2M 塩酸とアブレート粒子を混合させ、フィルタ ー上に得られた粒子表面の Si 2p の XPS 測定 結果を示す。Fig. 2b 中に黒線で示された XPS スペクトルのフィッティングカーブをピー ク分離すると、2 つのピークに分離された (Fig. 2b, 赤線、青線)。Fig. 2b 中に青線 で示されたピークは Si02 由来のものである。 Fig. 2b 中の赤線のピークは、Si02 由来のピ ークから 1.0 eV ほど低いエネルギー側に検 出された。SiO2, Na20 と SiC12 の XPS ピーク のエネルギー差は 1.0 eV 程度であることか ら 5)、赤線のピークは SiCl2 の化学種のシフ トと良い一致を示す。400℃の赤外加熱管内 で 2M 塩酸とアブレート粒子を混合した試料 から、SiCl2 の XPS ピークが得られた。よっ て、2M 塩酸をアブレート粒子と混合するこ とで、アブレート粒子の酸化物の一部が塩化 物へと置き換わる反応が起こっていること が判明した。Fig. 3bの SiO2 と SiCl2 のピー ク面積比は SiO2 : SiCl2 = 1 : 0.24 であっ た。

Si02 を 72%含んでいる NIST 610 ガラス標 準物質をハンマーとメノー乳鉢で粉砕した 粉末と、Si-C1 結合を構造中に持つ、97 % t-BuMe2SiCl を 1:1 で混合し、均一化したも のを XPS で測定した。この混合物の Si 2p 測 定結果を Fig. 2c に示す。Fig. 2c 中に黒線 で示された XPS スペクトルのフィッティング カーブをピーク分離すると、2 つのピークに 分離された(Fig. 2c, 青線、緑線)。Fig. 2c 中に青線で示されたピークは Si02 由来のも のである。Fig. 2c 中に緑線で示されたピー クは Et2SiCl2 (102.6 eV)由来のものと帰属

された。SiO2 と Et2SiCl2 のピークの面積比 は1:0.66 となった。2M 塩酸を 400℃の赤 外加熱管で混合した粒子の Si02 : SiCl2 を Fig. 2c の強度比から見積もった。Fig. 2c よ り SiO2 : SiCl2 = 1 : 1 で存在している標 準混合物について強度比は SiO2 : SiCl2 = 1 : 0.66 であった。塩酸混合粒子に SiO2 : SiCl2 = 1: x の割合で存在していたとする。 Fig. 2b より塩酸混合試料について強度比は SiO2: SiCl2 = 1:0.24 である。以上より、 2M 塩酸を 400℃の赤外加熱管で混合した粒 子の SiO2 : SiCl2 の割合は SiO2 : SiCl2 = 1: 0.35 となる。従って塩化物成分を全体 で割ると 0.35 ÷ (1.00 + 0.35) = 0.25 より、粒子表面の約 25 % が、酸化物から塩 化物へ組成が変化したと考えられる。しかし ながら、粒径 1 μm以下の粒子に対し、今回 は10 nm ほどの表面部分について XPS 測定を 行っているため、粒子の中心部分については 組成が変化していないと考えている。



Fig. 2(c)NIST610 と Et2SiCl2 を 1:1 で混合 した試料の XPS スペクトル

(5) 最適条件における回収率

最適条件として塩酸濃度を 2M, 赤外加熱 管の温度を 400℃に設定し、求めた回収率を Fig. 3 に示す。





Fig. 3 から全ての測定元素について超純 水を加えた場合に対して 2M 塩酸を加えた場 合の方が回収率が上昇したことが分かる。全 測定元素の回収率は 2M 塩酸を加えた時、超 純水と比較して平均 23%、Sr, Zr, Th とい った酸化物の融点の高い元素についてもそ れぞれ 66%から 95%, 66%から 99%, 32%から 68%と回収率の増加が確認でき、回収率は 100%に近い値をとった。従って、2M 塩酸を経

路の途中でアブレート粒子に混合すること で、酸化物の融点の高い元素に関してもアブ レート粒子の気化、原子化、イオン化の過程 が促進されたと考えられる。75Asに関しては、 40Ar35Cl の干渉が生じる。従って、75As に 関してのみ、m/z=76,77を同時に測定するこ とで、干渉の補正 6) を行い、回収率を算出 している。Fig. 3 には 75As の干渉補正後の 回収率を示している。2M 塩酸を加えた際の Sb は、他の元素と比較し回収率が高くなった。 フィルタに捕集された粒子は、その後酸分解 処理を施し、ICPMS で測定した。従って、フ ィルタ測定の酸分解処理においてフッ化水 素酸を、ホットプレートを用いて飛ばす際に、 Sb の揮発が生じたことが考えられる。As, Sb に関しては、ホットプレートを用いて酸分解 を行う際、揮発が生じることが知られている 6)。よってSbの回収率は130%と高くなった。 また、Mo, Pb, U の回収率はそれぞれ 71±23 %, 35±5 %, 63±10% と、回収率は 100 %を下 回った。測定元素の中で、Mo, Pb, U の元素 は酸化物の融点が低いことから、プラズマ中 でイオン化までの過程が促進された結果、サ ンプリングコーンの手前で拡散が起こった ことが原因と考えられる。その他の元素につ いては 2M 塩酸を混合した際の回収率は 100 %± 10%と良い一致を示した。低融点元 素の拡散による影響を考慮し、さらにサンプ リングデプスを 0.5 mm 近づけて測定を行い、 回収率を算出した結果を、Fig. 4 に示す。



Fig. 4 サンプリングデプス 8.4mm における アブレート粒子の回収率

Fig. 4 から、サンプリングデプスを近づけ ることで、酸化物の融点の低い Mo, Pb, U に ついて、Fig. 4 と比較してそれぞれ回収率は 123±13%, 81±7%, 112±12% と改善した。 一方で、Mn, Ti, Ba, Sr, Zr, Th といった酸 化物の融点の高い元素は、回収率が平均で 45%減少した。これは酸化物として高融点の 試料はサンプリングデプスを近づけたため に、プラズマ内でのアブレート粒子の気化、 原子化、イオン化が不完全であったことが原 因と考えられる。

(6) 結論

レーザーアブレーションで生成されたア ブレート粒子に、導入経路の途中で 2M 塩酸 溶液を気化し、HC1 ガスとして混合すること で、超純水を混合した場合と比較して 32% の 増加率の向上が観察された。これは、粒子中 の酸化物の一部が HC1 ガスにより塩化物に変 化したという組成の変化、及び酸による腐食 によって粒子の表面積の増加または表面の 特性変化という形状の変化といった2つの要 因によるものだと考えられる。XPS の結果か ら、アブレーション粒子と 2M 塩酸を 400℃ の赤外加熱管で混合した際、Si について粒 子表面の 25 % が酸化物から塩化物に変化し たと考えられる。また、塩酸濃度が 4M, 6M の場合、ロードエフェクトが生じ、増加率は 低下した。さらに、赤外加熱管の温度が高い ほど、増加率が上昇し、加熱管の温度が400℃ の時、200℃に対して 35 %上昇することが分 かった。赤外加熱管の温度については酸化物 の融点に関係した元素依存性がある。酸化物 の融点の低い As, T1, Sb は赤外加熱管の温 度上昇による増加率上昇が観察された。酸化 物の融点が高く塩化物の融点との差が大き い Th に関しては粒子の組成の変化が熱で促 進され、プラズマ中での気化促進による増加 率の上昇が起きたと考えられる。

アブレート粒子に 2M 塩酸を 400℃の赤外 加熱管で混合し、サンプリングデプスを 8.9 mm に設定し測定を行った際、全ての測定元素 について、回収率は HC1 ガスを粒子に混合さ せた場合では超純水を混合させた場合と比 較して平均 23%増加した。Sr, Zr, Th といっ た酸化物の融点の高い元素についてはそれ ぞれ 29%, 32%, 36 % 増加した。酸化物の融 点の低い元素についてはサンプリングコー ンの手前で拡散が生じることで、回収率が低 下した。しかし、サンプリングデプスを近づ けることで、Mo, Pb, U についてそれぞれ回 収率は 123 %, 81 %, 112 %となり、回収率 は改善された。このことから、本手法を用い ることで、プラズマへ導入される 1μm 以下 の粒子が、プラズマ内で効率よく原子化、イ オン化されるようになったと考えられる。本 手法を用いる際、酸化物の融点の低い元素は 拡散の影響を受けることに気を付ける必要 がある。

(7) 参考文献

1) Y. Suzuki, H. Sato, S. Hikida, K. Nishiguchi and N. Furuta, J. Anal. At. Spectrom., 2010, 25, 947-949.

2) D.R. Lide (Ed.), CRC Handbook of Chemistry and Physics, 86th ed., Taylor & Francis, 2005.

3) I. Kroslakova and D. Günther, J. Anal. At. Spectrom., 2007, 22, 51-62.

4) Lui Kwock On Thomas, Ph. D. Thesis, The University of Hong Kong, 2011.

5) Alexander V. Naumkin, Anna Kraut-Vass, Stephen W. Gaarenstroom, and Cedric J. Powell, NIST Standard Reference Database 20, Version 4.1, http://srdata.nist.gov/xps/, 2012.

6) U.S. Environmental Protection Agency,

Test methods for evaluating solid wastes physical/chemical methods, Method 6020 Inductively coupled plasma-mass spectrometry, CLP-M Ver. 9, 1994.

5. 主な発表論文等 (研究代表者、研究分担者及び連携研究者に は下線)

〔雑誌論文〕(計3件)

- R. Machida, <u>T. Nakazawa</u> and N. Furuta:"Temporal changes of size distribution of mass and relative intensity for ablated particles during laser ablation inductively coupled plasma mass spectrometry", J. Anal. At. Spectrom., 31(3), 809-814 (2016). 査読 有
- ② R. Machida, <u>T. Nakazawa</u>, Y. Sakuraba, M. Fujiwara and N. Furuta:"Particle size-related elemental fractionation in laser ablation in liquid inductively coupled plasma mass spectrometry", J. Anal. At. Spectrom., 30(12), 2412-2419 (2015). 査読有
- ③ R. Machida, <u>T. Nakazawa</u> and N. Furuta:" Temporal changes of fractionation index caused by changes in the large size of ablated particles in laser ablation-inductively coupled plasma mass spectrometry", Anal. Sci., 31(5), 345-355 (2015). 査読有

〔学会発表〕(計8件)

- ① N. Furuta, R. Fukushi, <u>T. Nakazawa</u>: Real time monitoring of multi-elements concentration in airborne nano-particles (ANPs) by direct introduction into ICPMS; 2016 Winter Conference on Plasma Spectrochemistry, 2016 年 1 月 Tucson, USA.
- ② M. Fujiwara, Y. Sakuraba, R. Machida, <u>T. Nakazawa</u>, N. Furuta: Precise and accurate determination of Sn in NIST 610 glass standard by laser ablation in liquid with isotope dilution ICPMS; 2015 International Chemical Congress of Pacific Basin Societies, 2015年12月 Honolulu, Hawaii.
- ③ R. Machida, <u>T. Nakazawa</u>, N. Furuta: Temporal changes in the fractionation index explained by the changes of size distribution of ablated particles; 2015 International Chemical Congress of Pacific Basin Societies, 2015 年 12 月 Honolulu, Hawaii.
- M. Furuta, R. Fukushi, <u>T. Nakazawa</u>: Real time monitoring of multi-elements concentration in airborne

nano-particles (ANPs) by direct introduction into ICPMS; 2015 International Chemical Congress of Pacific Basin Societies, 2015 年 12 月 Honolulu, Hawaii.

- ⑤ 福士 亮平, <u>中澤 隆</u>, 古田 直紀: ガス微 粒子化装置 (GPD) を用いた Sb と As の ガス状成分のリアルタイム分析; 日本分 析化学会第 64 年会, 2015 年 9 月 福岡.
- ⑥ 藤原 正英, <u>中澤 隆</u>, 古田 直紀: 液中レ ーザーアブレーション誘導結合プラズマ 質量分析法によるガラス標準物質 NIST 610 中の Sn の精確な定量; 日本分析化 学会第 64 年会, 2015 年 9 月 福岡.
- ⑦ S. Izumo, K. Nishiguchi, R. Machida, <u>T. Nakazawa</u>, N. Furuta: Improvement of the ionization in ICP by merging HCI gas to laser ablated particles; 2015 European Winter Conference on Plasma Spectrochemistry, 2015年2月 Munster, Germany.
- T. Nakazawa, R. Fukushi, N. Furuta: (8)Quantification of multi-elements in airborne particulate matter by real-time monitoring ICP-MS and their correlation with wind direction and 2015velocity; European Winter Conference Plasma on Spectrochemistry, 2015年2月 Munster, Germany.

〔図書〕(計0件)

〔産業財産権〕 〇出願状況(計0件)

```
○取得状況(計0件)
```

```
[その他]
```

```
ホームページ
```

http://envsun.chem.chuo-u.ac.jp/index2.ht m

6. 研究組織

(1)研究代表者

```
中澤 隆 (NAKAZAWA, Takashi)
```

中央大学・理工学部応用化学科・助教 研究者番号:10709687